基本配置要求

1.该分析仪必须是一套全自动运行的物理和化学吸附分析系统。可进行如下分析：

1.1静态物理吸附

1.2. \*静态化学吸附

1.3. \*全自动TPR/TPD/TPO

2．技术参数

2.1 物理吸附功能

2.1.1 分析站: 可以进行比表面及孔径分析，可以进行任何非腐蚀性气体物理吸附测试

2.1.2 P0站必须配有独立的1000torr压力传感器，可以实时测定P/P0值

2.1.3 脱气站：配有4个脱气站，真空脱气，电脑控制程序升温和抽空压力，具有过压保护功能

2.1.4\*分析站和脱气站必须在一台仪器上完成无需另外单独配脱气站，脱气站必须配有独立的压力传感器

2.1.5 \*脱气系统必须具有可装液氮的保护冷阱

2.1.6 压力传感器精度：±0.1％满量程。

2.1.7\*必须配有液位传感器，可精确控制液氮液面到±0.5mm

2.1.8杜瓦瓶持续工作时间：可达90小时，配备3L杜瓦瓶

2.2 \* 必须内置TCD检测器

2.2.1 TCD气体体积范围：0.001到大于100cc

2.2.2 TCD 重现性：对典型样品，优于0.5％

2.2.3 TCD 灯丝：必须配备钨铼合金灯丝

2.2.4 TCD与样品管出口之间必须带有保护冷阱

2.2.5 必须满足以下温度爬升速率：1 deg C / min to 100 deg C / min up to 500 deg C

1 deg C / min to 50 deg C / min up to 750 deg C

1 deg C / min to 30 deg C / min up to 1000 deg C

1 deg C / min to 20 deg C / min up to 1100 deg C

2.4 软件功能和分析方法

2.4.1等温线：用户可以在指定的目标压力选择数据点的个数；BET比表面积，朗格莫尔表面积

2.4.2 BJH孔径分布；Dollimore-Heal 孔径分布；Dubinin-Radushkevich 微孔面积，平均孔径，微孔体积，平均吸附能；总孔体积，平均孔径；统计壁厚（t－曲线）：de Boer，Halsey或碳黑模型；t法：微孔表面积，中孔表面积，微孔体积，相关系数

2.4.3微孔孔径分布模型：至少有MP，HK，SF，MC，非定域密度函数理论（NLDFT），QSDFT，6种以上

2.5.4至少提供25个NLDFT核心模型文件和两个QSDFT核心模型文件

**3仪器配置清单**

|  |
| --- |
| **ATTACHMENT TO THE** CONTRACT配置清单 |
| 货物名称 | 数量 |
| 程序升温化学吸附仪主机 | 1台 |
| 样品管 | 10个 |
| 电脑 | 1台 |
| 冷阱杜瓦 | 1个  |
| 高温炉 | 1个 |
| 液位传感器 | 1套 |
| 3L液氮杜瓦 | 1个 |